

jc836 U.S. PTO
08/28/00

08 - 29 - 00

PATENT

A

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
Washington, D.C. 20231

Date: August 28, 2000
File No.: 80101

Sir:

Transmitted herewith for filing is the patent application of:

Inventor(s): Satoru BUSHIDA and Motoharu NAKANE

For:

Enclosed are:

(X) 11 pages of specification, including 2 claims and an abstract.

() an executed oath or declaration, with power of attorney.

(X) an unexecuted oath or declaration, with power of attorney.

() sheet(s) of informal drawing(s).

(X) 4 sheet(s) of formal drawing(s).

() Assignment(s) of the invention to _____

() Assignment Form Cover Sheet.

() Associate power of attorney.

I hereby certify that this paper is being deposited with the United States Postal Service as Express Mail in an envelope addressed to: Box PATENT APPLICATION / Assistant Commissioner for Patents / Washington DC 20231 on this date.

August 28, 2000 EL617901328US
(date) Express Mail Label No.

Gerald T. Shekleton

jc836 U.S. PTO
09/648780
08/28/00

Fee Calculation For Claims As Filed

a) Basic Fee \$ 690.00

b) Independent Claims 1 - 3 = 0 x \$ 78.00 = \$ _____

c) Total Claims 2 - 20 = 0 x \$ 18.00 = \$ _____

d) Multiple Dependent Claims \$260.00 = \$ _____

() Statement(s) of Status as Small Entity, reducing Filing Fee by half to \$ _____

() A check in the amount of \$ _____ to cover the filing fee is enclosed.

() Charge \$ _____ to Deposit Account No. *****.

() Other

() The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees which may be required to this application under 37 C.F.R. §§1.16-1.17, or credit any overpayment, to Deposit Account No. *****. Should no proper payment be enclosed herewith, as by a check being in the wrong amount, unsigned, post-dated, otherwise improper or informal or even entirely missing, the Commissioner is authorized to charge the unpaid amount to Deposit Account No. *****.

120 South Riverside Plaza
22nd Floor
Chicago, Illinois 60606-3903
Telephone: (312) 655-1500

WELSH & KATZ, LTD.

By Gerald T. Shekleton
Gerald T. Shekleton
Registration No. 27,466

TITLE OF THE INVENTION

レーザ装置における光学部品駆動装置

BACKGROUND OF THE INVENTION

Field of the Invention

本発明はレーザ装置における光学部品の姿勢角を変化させる駆動装置に関するものである。

Description of the Related Art

エキシマレーザやフッ素分子F2 レーザなどをステッパの光源として用いる場合には、発振レーザ光を狭帯域化する必要がある。さらにこの狭帯域化された発振レーザ光のスペクトルの中心波長が露光中に目標値からずれないように高精度に安定化制御する必要がある。

図4 (a) は従来のレーザ装置に搭載される狭帯域化ユニット9の周囲の構造を示している。図4 (a) で一点鎖線はレーザ光軸Lを示す。図4 (b) は図4 (a) のIV-IV断面を示している。

狭帯域化は狭帯域化ユニット9内に設けられた反射型波長選択素子つまりグレーティング2に対してある所定の入射角（反射角） ϕ にてレーザ光を入反射させることによって行われる。反射型波長選択素子2はレーザ光Lを反射することによって波長を選択する光学部品である。反射型波長選択素子2は光入射角（光反射角） ϕ に応じた波長を選択する。光入射角 ϕ は、入射したレーザ光Lを全反射して反射型波長選択素子2にレーザ光Lを入射する反射鏡（全反射ミラー）3の姿勢角度 θ に応じて定まる。反射鏡3の姿勢角度 θ は送りねじユニット16の送りねじ（おねじ）16aが矢印B方向に直動することによって変化する。制御モータ8が矢印C方向に回転することによって送りねじ16aが直動する。

露光中は発振レーザスペクトルの中心波長の変動が極微小となるように制御モータ8が駆動制御される。すなわち制御モータ8の駆動軸8aが矢印C方向

に正転または反転することにより送りねじ16aが同方向Cに回転し、これに応じて送りねじ16aが矢印B方向に往復運動し送りねじ16aの送り位置が位置決めされる。これによって反射鏡3の姿勢角 θ が定まり、これに応じて反射型波長選択素子2に対する光入射角 ϕ が定まり、これに応じてレーザ光Lのスペクトルの中心波長が目標波長に固定される。

ここで送りねじユニット16にはいわゆる高精度ねじが使用されている。高精度ねじは送りねじ（おねじ）16aとナット（めねじ）16bとの間のねじ隙間が極小となるように加工したものである。具体的には送りねじ16aとナット16bの一対を現物合せて管理している。また送りねじ16aとナット16bの間の接触摩擦を低減するために、潤滑材（グリース）を送りねじ16aとナット16bとが接触する部分Dに多量に塗布している。

しかし送りねじユニット16のねじ隙間を現物合わせて極小にすることはできても、ねじ隙間を極少なくすることは構造上不可能であり、必ず極小なねじ隙間が生じる。つまり送りねじユニット16のバックラッシをゼロにすることはできない。このため制御モータ8を矢印B方向に正転反転し、送りねじ16aが矢印B方向に往復運動すると、反射鏡3の位置決めの精度が悪化する。反射鏡3の位置決めの精度が悪化すると、レーザ光Lを目標波長にする制御の精度が悪化し、波長安定性が悪化することになる。つまり波長制御の精度が低下し波長安定性が低下するという問題が発生する。

また従来の送りねじユニット16はねじ隙間を極小としているため送りねじユニット16が駆動する際の摩擦抵抗が大きい。このため送りねじユニット16を駆動するのに必要な制御モータ8の回転トルクが大きくなる。したがって制御モータ8への駆動指令に対する送りねじ16aの直線運動の応答性は良くなく、レーザ光Lの波長を目標波長へ変更するまでの所要時間が長くなる。つまり波長制御の速度が低下するという問題が発生する。

送りねじユニット16が駆動する際の摩擦抵抗を低減するためには、接触部Dに多量の潤滑材を塗布する必要がある。しかし接触部Dは狭帯域化ユニット

9の内部と連通している。狭帯域化ユニット9の内部は深紫外の波長領域のエキシマレーザ光Lが散乱している。このため深紫外光が潤滑材に照射され潤滑剤の化学的な分解反応が進行するおそれがある。潤滑剤の化学的な分解反応が進行するとそれによって発生した不純物が狭帯域化ユニット9の内部の光学部品を汚染しレーザ装置としての性能が劣化するおそれがある。つまり光学部品の汚染によりレーザ装置の性能が低下するという問題が発生する。

OBJECTS AND SUMMARY THE INVENTION

本発明はこうした実状に鑑みてなされたものであり、レーザ装置において波長制御の精度、波長安定性を向上させるとともに、波長制御速度を高め、さらに光学部品の汚染を防止できるようにすることを解決課題とするものである。

そこで、本発明は、上記解決課題を達成するために、

姿勢角(θ)に応じてレーザ光(L)の波長を変更させる光学部品(3)と、回転アクチュエータ(8)の回転運動を送りねじ(6a)の直線運動に変換する送りねじ機構(6)とを備え、前記送りねじ機構(6)の送りねじ(6a)が直動するに応じて前記光学部品(3)の姿勢角(θ)を変化させるようにしたレーザ装置における光学部品駆動装置において、

前記送りねじ機構(6)の送りねじ(6a)を、ボールねじ(6a)としたこと

を特徴とする。

本発明を図1(a)、図1(b)を参照して説明する。

ボールねじユニット6はボールねじ6aとナット6bとの間に予圧(プリード)をかけて使用しボールが滑ることでボールねじ6aが直動する送りねじ機構である。このため機械的なねじ隙間を極少なくすることが構造上可能である。このためボールねじユニット6のバックラッシュをゼロに、つまりノンバックラッシュにすることができる。ねじ隙間がゼロであるので、制御モータ8が矢印C方向に正転反転し送りねじ16aが矢印B方向に往復運動したときの反射

鏡3の位置決めの精度が向上する。反射鏡3の位置決めの精度が向上するため、レーザ光Lを目標波長にする制御の精度が向上し、波長安定性が向上する。

またボールが滑ることでボールねじ6aが直動するためボールねじユニット6が駆動する際の摩擦抵抗は小さい。このためボールねじユニット6を駆動するのに必要な制御モータ8の回転トルクは小さくて済む。したがって制御モータ8への駆動指令に対するボールねじ6aの直線運動の応答性が向上し、レーザ光Lの波長を目標波長へ変更するまでの所要時間を短くすることができる。

更に波長制御の精度が向上し目標波長へ変更するまでの所要時間を短くできるので、波長制御の速度を高めることができる。

ボールねじユニット6の摩擦抵抗が小さいので、接触部Dに塗布する潤滑材の量を必要最小限の微量に抑えることができる。このため深紫外光が潤滑材に照射されたとしてもそれによって発生する不純物は微量であり、狭帯域化ユニット9の内部の光学部品の汚染を最小に抑えることができ、レーザ装置としての性能の劣化を防止できる。

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

図1 (a) は実施形態の光学部品駆動装置を示す図であり、図1 (b) は図1 (a) の I-I 断面図である。

図2は実施形態装置の効果を説明するグラフあり、横軸をレーザ光の波長領域で示し縦軸をレーザ光の波長制御の誤差幅で示したグラフである。

図3は実施形態装置の効果を説明するグラフであり、横軸をレーザ光の波長変更量で示し、縦軸を変更に要する時間で示したグラフである。

図4 (a) は従来の光学部品駆動装置を示す図であり、図4 (b) は図4 (a) の IV-IV 断面図である。

DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS

以下図面を参照して本発明に係るレーザ装置における光学部品駆動装置の実

施の形態について説明する。なお実施形態ではレーザ装置をステッパの光源として用いる場合を想定する。

図1 (a) は実施形態の光学部品駆動装置を示している。図1 (a) はレーザ装置に搭載される狭帯域化ユニット9の周囲の構造を示している。図1 (a) で一点鎖線はレーザ光軸Lを示す。図1 (b) は図1 (a) のI-I断面を示している。

まずレーザ装置における狭帯域化ユニット9の機能について説明する。

すなわち図示しないレーザチャンバで放電励起されることによって発振されたレーザ光Lは、図示しないフロントミラーと狭帯域化ユニット9とで構成する共振器内を往復移動することによって増幅されフロントミラーから所定パワーのレーザ光Lとして射出される。この実施形態ではフロントミラーと反射型波長選択素子2との間でレーザ光Lが往復する。

狭帯域化ユニット9内には、たとえば2つのプリズム1a、1bと、反射鏡(全反射ミラー)3と、反射型波長選択素子(グレーティング)2という光学部品が配置されている。なおプリズムの数は任意である。プリズム1a、1b、反射型波長選択素子2は狭帯域化ユニット9の底板に固定されている。反射鏡3は反射鏡保持部材(ミラーホルダ)4によって保持されている。反射鏡保持部材4は支持部材5によって回動自在に支持されている。すなわち反射鏡保持部材4は支持部材5による支持位置を回動支点として回動するため、その回動に応じて反射鏡3の姿勢角θが変化する。反射鏡保持部材4を回動させ反射鏡3の姿勢角θを変化させる駆動機構については後述する。

レーザチャンバで発振されたレーザ光Lは狭帯域化ユニット9内に入射され、ビームエキスパンダとして機能するプリズム1a、1bを透過することによってそのビーム幅が拡大される。さらに拡大されたレーザ光Lは反射鏡3に入射され全反射されて反射型波長選択素子2に入射される。反射型波長選択素子2に入射されたレーザ光Lは回折されることにより、所定の波長成分のレーザ光Lのみが入射光と同じ方向に折り返される。反射型波長選択素子2で折り返さ

れたレーザ光Lは、プリズム1b、1aによってビーム幅が縮小された後、レーザチャンバに入射される。レーザチャンバを通過して増幅されたレーザ光Lは、フロントミラーを介してその一部が出力光として取り出されるとともに、残りが再度レーザチャンバに戻って増幅される。

レーザ装置をステッパの光源として用いる場合、発振レーザ光を狭帯域化する必要がある。さらにこの狭帯域化された発振レーザ光のスペクトルの中心波長が露光中に目標値からずれないように高精度に安定化制御する必要がある。

狭帯域化は反射型波長選択素子2によって行われる。前述したように反射型波長選択素子2はレーザ光Lを入反射することによって波長を選択する。反射型波長選択素子2は光入射角（光反射角） ϕ に応じた波長を選択する。光入射角 ϕ は、反射型波長選択素子2にレーザ光Lを入射させる反射鏡3の姿勢角度 θ に応じて定まる。

つぎに反射鏡3の姿勢角度 θ を変化させる駆動機構の構成について説明する。

反射鏡保持部材4の姿勢角 θ は、送りねじ機構であるボールねじユニット6を駆動することによって変化する。ボールねじユニット6はボールねじ6aとナット6bとからなる。ボールねじユニット6は、ボールが滑ることでボールねじ6aがナット6bに対して相対的に直動する送りねじ機構である。ボールねじ6aの一端は反射鏡保持部材4に当接している。また反射保持部材4がボールねじ6aに当接する方向に、板ばね10によるばね力が反射保持部材4に付与されている。

ボールねじ6aの他端はカップリング7を介して制御モータ8の駆動軸8aに接続している。ナット6bはボールねじ6aに螺合しており、狭帯域化ユニット9の壁面に固定されている。

制御モータ8はステッピングモータ、サーボモータなどが使用され、LMガイドなどのガイド機構11に矢印B方向に往復移動自在に支持されている。ガイド機構11は狭帯域化ユニット9の外側に固定されている。

つぎに上述した光学部品駆動装置の動作について説明する。

露光中は発振レーザスペクトルの中心波長の変動が極微小となるように制御モータ8が駆動制御される。なお制御はフィードバック制御であってもオープン制御であってもよい。フィードバック制御の場合には、発振レーザ光の波長が検出され、図示しないコントローラにフィードバックされる。

コントローラは制御モータ8に対して駆動指令信号を出力する。この駆動指令信号に応じて駆動軸8aが矢印C方向に正転または反転する。

制御モータ8の駆動軸8aが矢印C方向に回転すると、ボールねじ6aが同方向Cに回転する。このためボールねじ6aはナット6bに対して相対的に矢印B方向に直動する。つまりボールねじ6aは狭帯域化ユニット9に対して相対的に直動する。ボールねじ6aはカップリング7を介して制御モータ8とともに矢印B方向に直動する。制御モータ8はガイド機構11のガイドに案内されて矢印B方向に移動する。

以上のようにしてボールねじ6aが狭帯域化ユニット9に対して相対的に直動すると、ボールねじ6aに当接している反射鏡保持部材4が、支持部材5を回動支点にして回動する。この結果反射鏡3の姿勢角 θ が変化する。こうして反射鏡3はボールねじ6aの直動位置に応じた姿勢に位置決めされる。

反射鏡3の姿勢角 θ が定まると、反射型波長選択素子2に対する光入射角 ϕ が定まり、これに応じてレーザ光Lのスペクトルの中心波長が目標波長に固定される。

つぎに本実施形態による効果について図2、図3を併せ参照して説明する。

本実施形態では送りねじ機構としてボールねじユニット6が使用されている。

ボールねじユニット6はボールねじ6aとナット6bとの間に予圧（プリロード）をかけて使用しボールが滑ることでボールねじ6aが直動する送りねじ機構である。このため機械的なねじ隙間を極少なくすることが構造上可能である。このためボールねじユニット6のバックラッシュをゼロに、つまりノンバックラッシュにすることができる。ねじ隙間がゼロであるので制御モータ8が矢印B方向に正転反転し送りねじ16aが矢印B方向に往復運動したときの反射鏡

3の位置決めの精度が向上する。反射鏡3の位置決めの精度が向上するため、レーザ光Lを目標波長にする制御の精度が向上し、波長安定性が向上する。

図2は図1(a)に示す実施形態装置と図4(a)の従来装置との効果の違いを比較して示したグラフである。横軸はレーザ光Lの波長領域(単位pm)であり反射鏡3の姿勢角 θ に対応している。縦軸は反射鏡3の位置決め精度つまりレーザ光Lの目標波長に対する誤差幅(単位pm)である。具体的には各波長領域で±2pm分だけ反射鏡3の姿勢角 θ を変化させたときの誤差幅を示している。ボールねじユニット6を使用した実施形態装置の特性を6Cで示し、高精度ねじ16を使用した従来装置の特性を16Cで示す。

特性6Cと特性16Cを比較して明らかなように、実施形態装置の誤差幅は、全波長領域において従来装置の誤差幅より減少しており、従来装置より波長制御精度、波長安定性が向上しているのがわかる。

また本実施形態装置によればボールが滑ることでボールねじ6aが直動するためボールねじユニット6が駆動する際の摩擦抵抗は小さい。このためボールねじユニット6を駆動するのに必要な制御モータ8の回転トルクは小さく済む。したがって制御モータ8への駆動指令に対するボールねじ6aの直線運動の応答性が向上し、レーザ光Lの波長を目標波長へ変更するまでの所要時間を短くすることができる。

更に波長制御の精度が向上し目標波長へ変更するまでの所要時間を短くできるので、波長制御の速度を高めることができる。

図3は図1(a)に示す実施形態装置と図4(a)の従来装置との効果の違いを比較して示したグラフである。横軸はレーザ光Lの波長変更量(単位pm)であり反射鏡3の姿勢角 θ の変化量に対応している。縦軸はレーザ光Lの波長を目標波長へ変更するまでの所要時間(単位sec)である。ボールねじユニット6を使用した実施形態装置の特性を6Dで示し、高精度ねじ16を使用した従来装置の特性を16Dで示す。

特性6Dと特性16Dを比較して明らかなように、実施形態装置の所要時間

は、従来装置の所要時間より短縮されており、従来装置より波長制御速度が高められているのがわかる。

また本実施形態装置によればボールねじユニット6の摩擦抵抗が小さいので、接触部Dに塗布する潤滑材の量を必要最小限の微量に抑えることができる。このため深紫外光が潤滑材に照射されたとしてもそれによって発生する不純物は微量であり、狭帯域化ユニット9の内部の光学部品の汚染を最小に抑えることができ、レーザ装置としての性能の劣化を防止できる。

以上のように本実施形態によればレーザ装置において波長制御の精度、波長安定性が向上するとともに、波長制御速度が高められ、さらに光学部品の汚染を防止することができる。

なお本実施形態では光学部品として反射鏡3の姿勢角 θ を変化させることによって反射型波長選択素子3への光入射角 ϕ を変化させそれによって発振レーザ光Lの波長を変化させている。しかし光学部品として他の光学部品の姿勢角を変化させることによって同様にレーザ光Lの波長を変化させてもよい。

たとえばプリズム1a、1bの姿勢角を変化させることによってレーザ光Lの波長を変化させてもよく、反射型波長選択素子2の姿勢角を変化させることによってレーザ光の波長を変化させてもよい。この場合も光学部品を駆動させる駆動機構として実施形態と同様にボールねじユニット6を使用すれば、波長制御精度、波長制御速度が向上するなど実施形態と同様の効果が得られる。

CLAIMS

1. 姿勢角に応じてレーザ光の波長を変更させる光学部品と、回転アクチュエータの回転運動を送りねじの直線運動に変換する送りねじ機構とを備え、前記送りねじ機構の送りねじが直動するに応じて前記光学部品の姿勢角を変化させるようにしたレーザ装置における光学部品駆動装置において、

前記送りねじ機構の送りねじを、ボールねじとしたことを特徴とするレーザ装置における光学部品駆動装置。

2. 前記光学部品は、姿勢角に応じて反射型波長選択素子に対する入射角度が変化する光学部品であることを特徴とする請求範囲1記載のレーザ装置における光学部品駆動装置。

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

レーザ装置において波長制御の精度、波長安定性を向上させるとともに、波長制御速度を高め、さらに光学部品の汚染を防止できるようにする。光学部品の姿勢角を変化させる送りねじ機構の送りねじを、ボールねじとする。

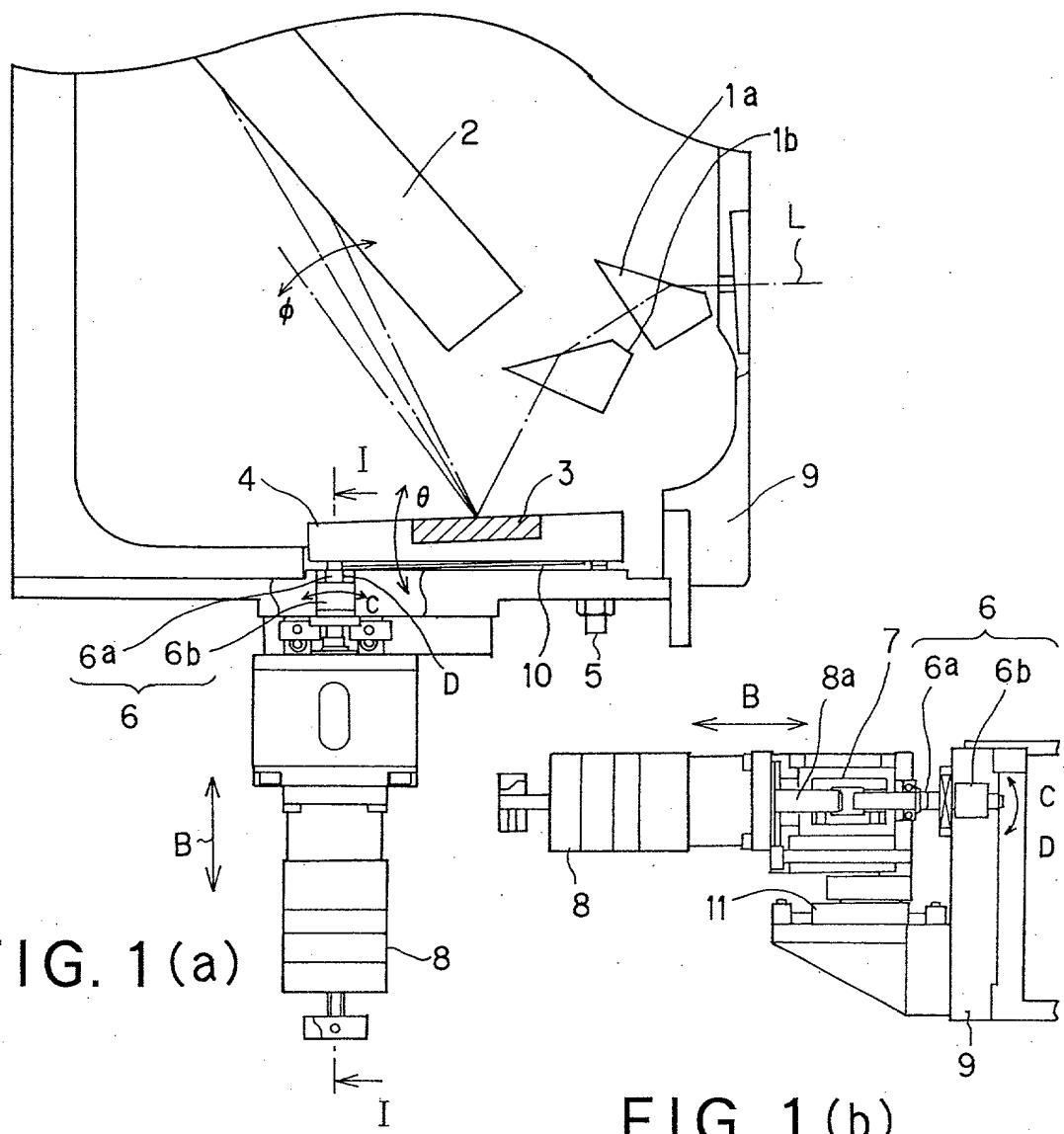


FIG. 2

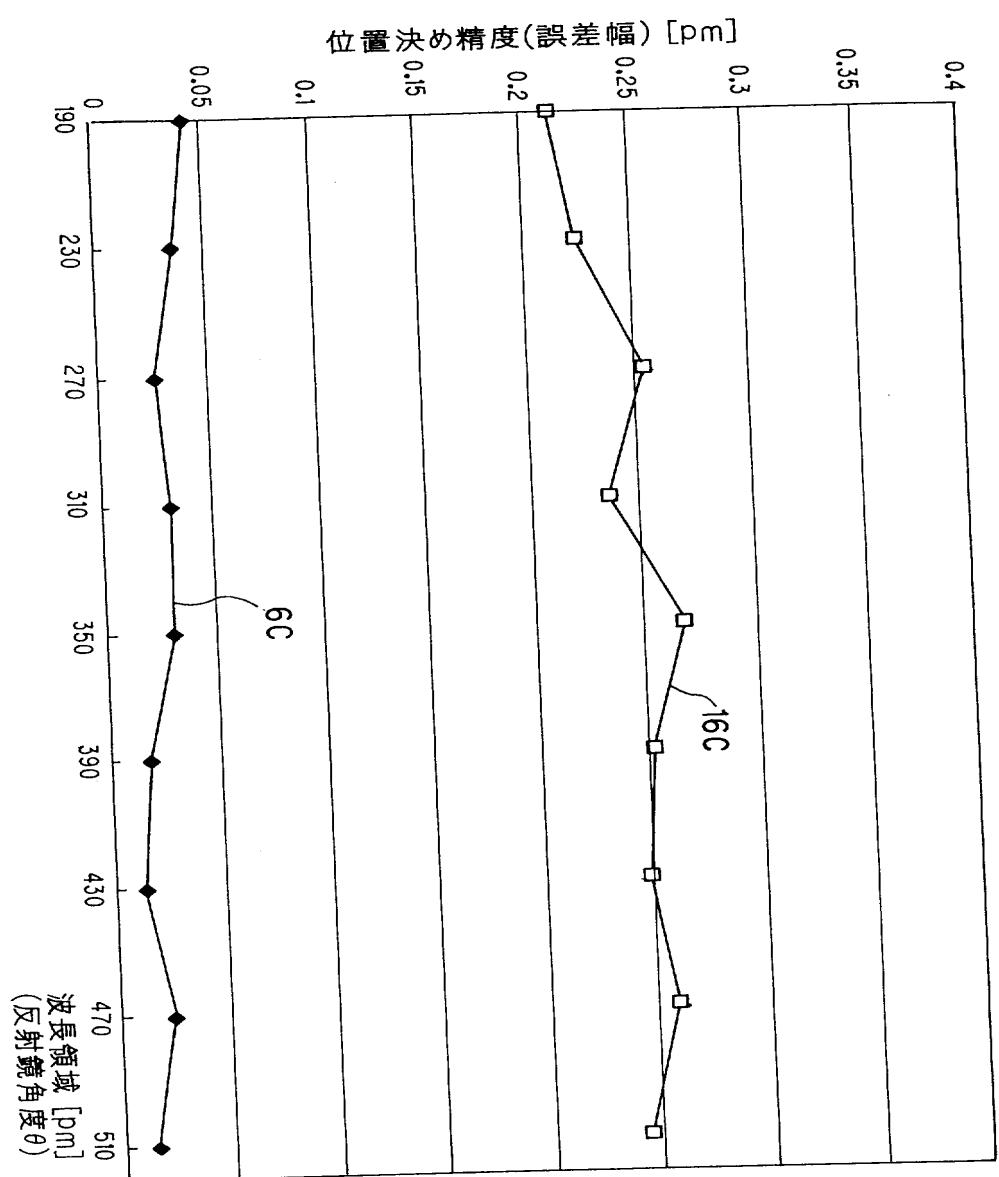
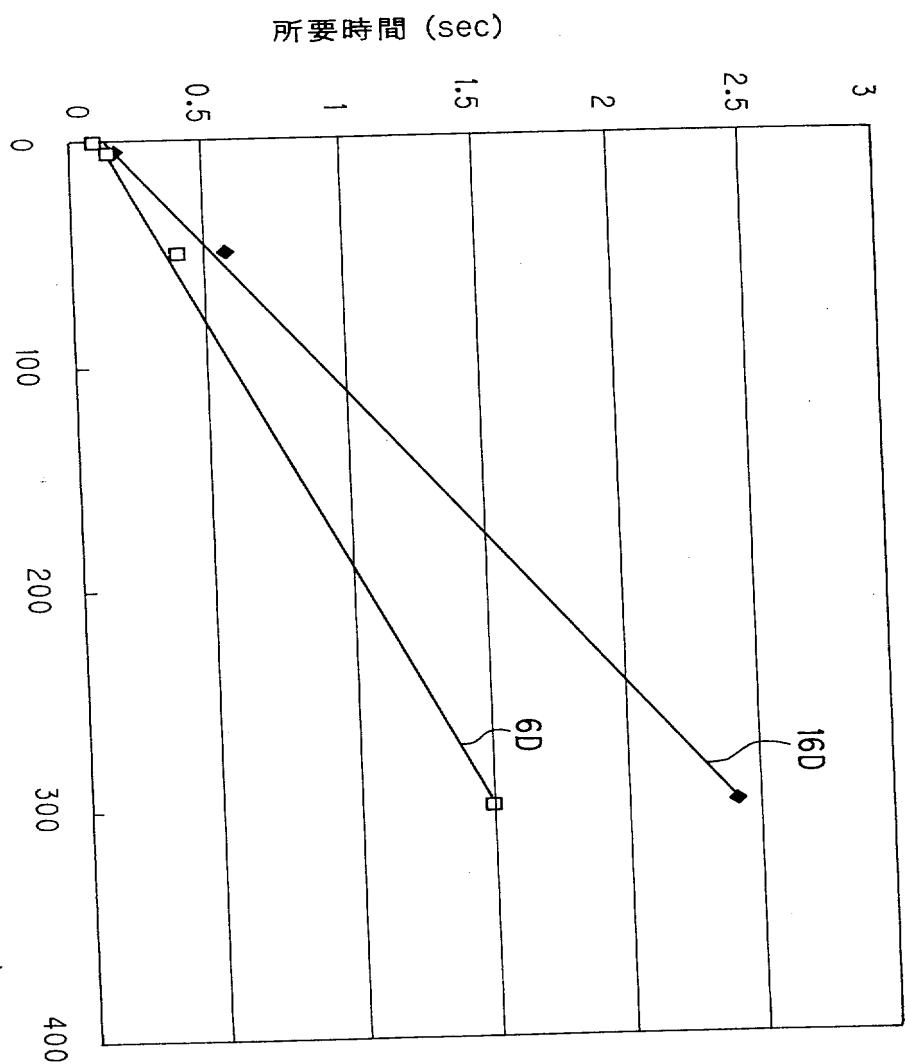
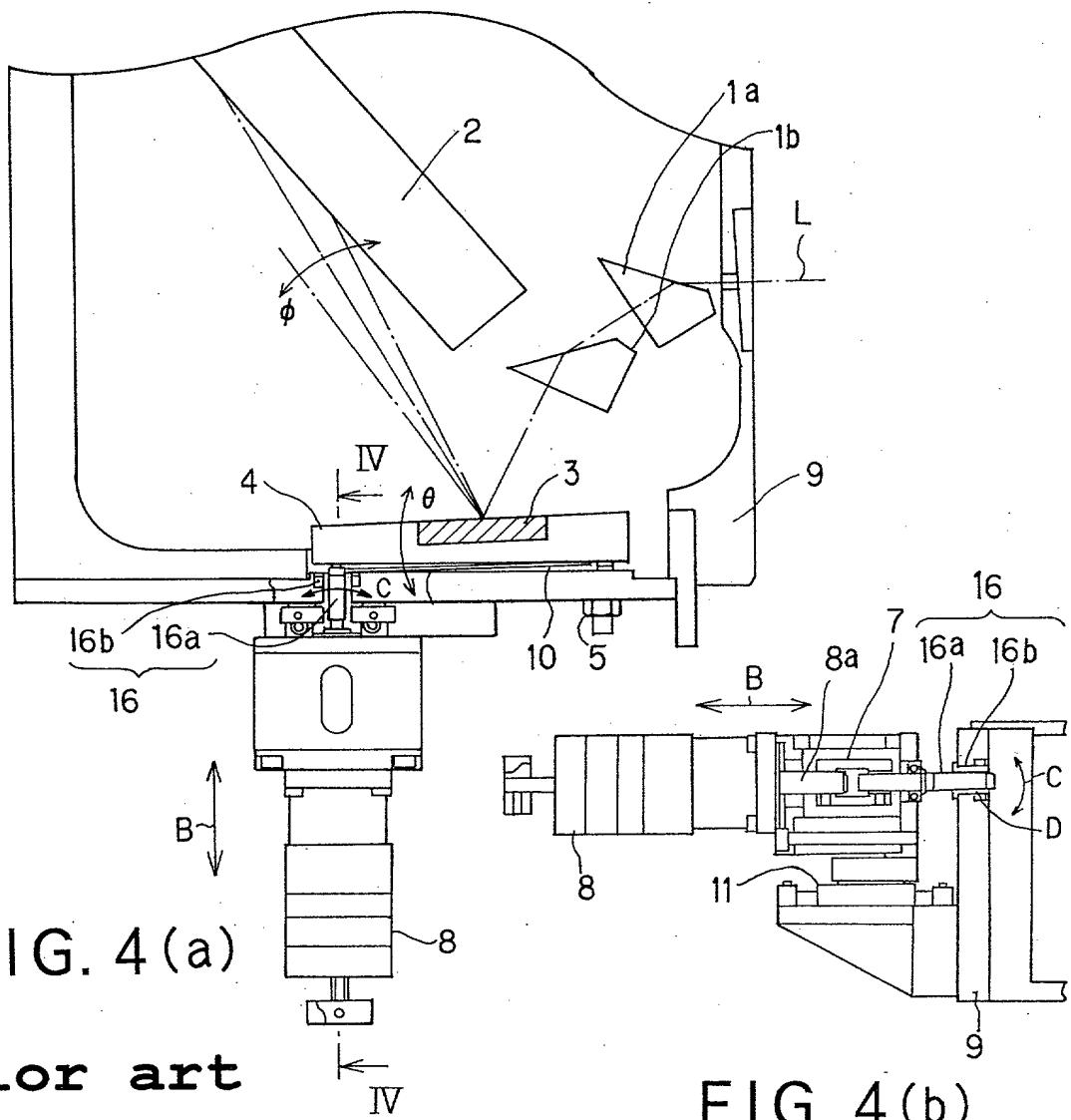


FIG. 3





prior art

prior art

DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY

As a below named inventor, I hereby declare:

That my residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name.

That I verily believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural inventors are named below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled: the specification of which (check one)

is attached hereto.

was filed on as Application, Serial No. and was amended on _____ (if applicable).

That I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

That I acknowledge the duty to disclose information known to be material to patentability of this application in accordance with Title 37, Code of Federal Regulations §1.56(a).

That I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code, §119 of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate on this invention having a filing date before that of the application on which priority is claimed:

Prior Foreign Application(s)	Priority Claimed			
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	Yes	No

That I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §120 of any United States application(s) listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, §112, I acknowledge the duty to disclose material information as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56(a) which occurred between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application:

United States Application(s)

(Application Serial No.)	(Filing Date)	(Status)-(Patented, pending, abandoned)
--------------------------	---------------	---

That all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

I hereby appoint the following attorneys, with full power of substitution and revocation, to prosecute this application and to transact all business in the United States Patent and Trademark Office connected therewith and request that all correspondence and telephone calls in respect to this application be directed to: WELSH & KATZ, LTD., 120 South Riverside Plaza, 22nd Floor, Chicago, Illinois 60606-3913, Telephone No.: (312) 655-1500:

<u>Attorney</u>	<u>Registration No.</u>
A. Sidney Katz	24,003
Richard L. Wood	22,839
Jerold B. Schnayer	28,903
Eric C. Cohen	27,429
Joseph R. Marcus	25,060
Gerald S. Schur	22,053
Gerald T. Shekleton	27,466
James A. Scheer	29,434
Daniel R. Cherry	29,054
Edward P. Gamson	29,381
Kathleen A. Rheintgen	34,044
Thomas W. Tolpin	27,600

Full name of sole or one joint inventor:

Satoru BUSHIDA

Inventor's signature:

Date:

Residence and Post Office Address:

c/o Oyama Works of Komatsu Ltd.

400 Yokokura-Shinden, Oyama-shi

Tochigi, Japan

Citizenship:

Japanese

Full name of sole or one
joint inventor:

Motoharu NAKANE

Inventor's signature:

Date:

Residence and Post Office Address:

c/o Oyama Works of Komatsu Ltd.

400 Yokokura-Shinden, Oyama-shi

Tochigi, Japan

Citizenship:

Japanese

Address for Correspondence:

WELSH & KATZ, LTD.

120 South Riverside Plaza

22nd Floor

Chicago, Illinois 60606-3913